

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成26年10月9日(2014.10.9)

【公開番号】特開2013-62027(P2013-62027A)

【公開日】平成25年4月4日(2013.4.4)

【年通号数】公開・登録公報2013-016

【出願番号】特願2011-197810(P2011-197810)

【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

G 0 2 F 1/1339 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

H 0 1 L 27/32 (2006.01)

G 0 9 F 9/00 (2006.01)

H 0 5 B 33/12 (2006.01)

H 0 1 J 9/26 (2006.01)

H 0 1 J 11/46 (2012.01)

H 0 1 J 11/48 (2012.01)

【 F I 】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/10

G 0 2 F 1/1339 5 0 5

G 0 9 F 9/30 3 0 9

G 0 9 F 9/30 3 6 5 Z

G 0 9 F 9/00 3 3 8

G 0 9 F 9/30 3 4 9 B

H 0 5 B 33/12 E

H 0 1 J 9/26 A

H 0 1 J 11/02 D

【手続補正書】

【提出日】平成26年8月27日(2014.8.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の基板の表面に第1の低融点ガラスを形成する工程と、
前記第1の低融点ガラスに第3の基板を押付けた状態で、前記第1の低融点ガラスに第1の加熱処理を施し、前記第1の低融点ガラスを第2の低融点ガラスとする工程と、
前記第3の基板を前記第2の低融点ガラスから剥離させる工程と、
前記第2の低融点ガラスと接するように第2の基板を配置して、前記第2の低融点ガラスに第2の加熱処理を施して、前記第1の基板と前記第2の基板を接合する第3の低融点ガラスを形成する工程と、を有することを特徴とする封止体の作製方法。

【請求項2】

請求項 1 において、

前記第 3 の基板の表面がチタンであることを特徴とする封止体の作製方法。

【請求項 3】

レーザー光が透過する第 1 の基板の表面に第 1 の低融点ガラスを形成する工程と、
前記第 1 の低融点ガラスに第 3 の基板を押付けた状態で、前記第 1 の低融点ガラスに第 1 の加熱処理を施し、前記第 1 の低融点ガラスを第 2 の低融点ガラスとする工程と、
前記第 3 の基板を前記第 2 の低融点ガラスから剥離させる工程と、
発光素子が設けられた第 2 の基板の面を、前記第 2 の低融点ガラスと接するように配置して、前記第 2 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 2 の加熱処理を施して、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板を接合する第 3 の低融点ガラスを形成する工程と、を有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 4】

レーザー光が透過する第 1 の基板の表面に第 1 の低融点ガラスを形成する工程と、
前記第 1 の基板の前記第 1 の低融点ガラスが設けられた面に、有機樹脂を含むカラーフィルタを形成する工程と、
前記第 1 の低融点ガラスに第 3 の基板を押付けた状態で、前記第 1 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 1 の加熱処理を施し、前記第 1 の低融点ガラスを第 2 の低融点ガラスとする工程と、
前記第 3 の基板を前記第 2 の低融点ガラスから剥離させる工程と、
発光素子が設けられた第 2 の基板の面を、前記第 2 の低融点ガラスと接するように配置して、前記第 2 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 2 の加熱処理を施して、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板を接合する第 3 の低融点ガラスを形成する工程と、を有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 5】

レーザー光が透過する第 1 の基板の表面に第 1 の低融点ガラスと発光素子を形成する工程と、
前記第 1 の低融点ガラスに第 3 の基板を押付けた状態で、前記第 1 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 1 の加熱処理を施し、前記第 1 の低融点ガラスを第 2 の低融点ガラスとする工程と、
前記第 3 の基板を前記第 2 の低融点ガラスから剥離させる工程と、
前記第 2 の低融点ガラスと接するように第 2 の基板を配置して、前記第 2 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 2 の加熱処理を施して、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板を接合する第 3 の低融点ガラスを形成する工程と、を有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 6】

レーザー光が透過する第 1 の基板の表面に第 1 の低融点ガラスと発光素子を形成する工程と、
前記第 1 の低融点ガラスに第 3 の基板を押付けた状態で、前記第 1 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 1 の加熱処理を施し、前記第 1 の低融点ガラスを第 2 の低融点ガラスとする工程と、
前記第 3 の基板を前記第 2 の低融点ガラスから剥離させる工程と、
有機樹脂を含むカラーフィルタが設けられた第 2 の基板の面を、前記第 2 の低融点ガラスと接するように配置して、前記第 2 の低融点ガラスにレーザー光を照射する第 2 の加熱処理を施して、前記第 1 の基板と前記第 2 の基板を接合する第 3 の低融点ガラスを形成する工程と、を有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項 7】

請求項 3 乃至 6 のいずれか一項において、

前記第 3 の基板の表面がチタンであることを特徴とする発光装置の作製方法。